2017/1/21 望遠鏡および観測装置会議@キャンパスプラザ京都

# 極限補償光学装置の進捗

#### 山本広大(京都大学) SEICA開発チーム

京大岡山3.8m望遠鏡架台

惑星撮像装置SEICA[<u>S</u>econd-generation Exoplanet Imager with <u>C</u>oronagraphic <u>A</u>o] SEICA

#### 内容

- SEICAの意義・目的
- SEICA-ExAOの進捗









# <u>SEICA: ExAOパート(極限補償光学系)</u>

#### <mark>傾斜</mark>計測: T/T+Woofer 低速、粗い波面制御

<mark>位相</mark>計測: Tweeter 高速、高精度波面制御



### <u>SEICA: ExAO後のコントラスト</u>

乱流層:	高度10km		
フリード長:	10cm		
風速:	10m/s		
天頂角: 60度 (仰角30度)			
センサー波長:0.8um			
観測波長:	1.65um		
波面測定:	8.5kHz (制御850Hz		
補償点数:	差し渡し24素子		
	計495素子		



#### 大気乱流と補償後のパワースペクトル





補償前/後の位相形状と星像(時間平均なし: 10msec)

## <u>ExAO進捗:</u>

- 1. AO制御実験[Woofer AO]
  - 1. Woofer実験環境整備

1. 光学系調整

- 2. Woofer実験開始
  - 1. 基準実験系での試験 [AO基本性能, 風速, 等級etc...]
  - 2. WFSパラメータの最適化試験[マイクロレンズ, ROI etc...]
  - 3. 近赤外対応
- 2. SEICA実機設計: Woofer AO
  - 1. Woofer用SHWFS構造体最終設計
- 3. H29年度予算への応募
  - 1. 自然科学機構(NINS)分野融合共同研究
  - 2. 国立天文台共同開発経費

#### <u>ExAOパート:: WooferAO動作</u>



AO時 FWHM ~6pix 回折限界 FWHM 4.5pix

Woofer AO動作時の星像 (He-Neレーザ光源, 風速10m/s, 制御900Hz)

#### <u>ExAOパート:: 評価試験 星像モニタ</u>







X pixel

風速 10m/s 制御無し 風速 10m/s 制御周波数900Hz λ=633nm 風速10m/s 星像モニタ(16秒間平均 26fps)



#### ExAO/۱ :評価試験 SR測定





Strehl Ratio @600nm(%)



# SR=0.4%

風速 10m/s 制御無し



風速 10m/s 制御周波数900Hz

λ=633nm 風速10m/s 星像モニタ(16秒間平均 26fps)

## <u>ExAOパート:: 性能評価試験</u>









試験光源系



非点収差が大→レンズの設置角度を ±0.5度以内

- 波面精度PV: 0.16λ, rms:  $0.04\lambda \rightarrow SR=0.92$ レンズの角度確認







光源(ファイバー) 高さ,角度ズレ

高さ,角度 100um, 1分角 ~回転亡つ

レンズの背後に	で調整完了				
平面鏡設置	SR	位相板	前回	今回	
	リファレンス		0.5	0.8	
	試験光源	なし	0.3	0.8	
		あり	0.004	0.003	



試験光源系



非点収差が大→レンズの設置角度を ±0.5度以内

- 波面精度PV: 0.16λ, rms:  $0.04\lambda \rightarrow SR=0.92$ レンズの角度確認









光源(ファイバー) 高さ,角度ズレ

高さ,角度 100um, 1分角 で囲動中マ

SR	位相板	前回	今回	
リファレンス		0.5	0.8	
試験光源	なし	0.3	0.8	
	あり	0.004	0.003	









## <u>SEICA: 全体進捗: 今回</u>

- ExAO: Woofer AOの開発進行
  - 実験環境再整備: 岡山上空(フリード長10cm, 風速10m/s)
  - AO実験 SR=0.03-0.05程度が何処まで改善するか(@633nm)
  - 実機設計開始: ABCとの協同で。

近赤外ではSR~0.1程度

- NINS, 天文台へTweeter用予算
- ・ コロナグラフ: SPLINE
  - プリズム/サバール板
    - 確保·原理実証済
  - 実機製作開始:設計中
- ・ ポストプロセス: スペックルナリング方式
  - 原理実証試験準備開始: 物品確保完了
- 温度管理範囲
  - コロナグラフで温度測定、管理の試験